06.1;06.5

Структура и сегнетоэлектрические свойства гетероэпитаксиальных тонких пленок NaNbO₃, полученных методом RF-катодного распыления

© А.В. Павленко^{1,2}, Д.В. Стрюков¹, Н.В. Тер-Оганесян²

¹ Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия ² Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия E-mail: Antvpr@mail.ru

Поступило в Редакцию 23 сентября 2019 г. В окончательной редакции 9 октября 2019 г. Принято к публикации 14 октября 2019 г.

Впервые методом RF-катодного распыления в атмосфере кислорода получены тонкие пленки NaNbO₃ на подложке MgO(001), на которую предварительно был осажден слой SrRuO₃. По данным рентгенодифракционного анализа установлено, что пленки являются однофазными и монокристаллическими. Параметры элементарных ячеек в тетрагональном приближении для слоев NaNbO₃ и SrRuO₃ составили $c_{\text{NaNbO}_3} = 0.3940$ (1) nm, $a_{\text{NaNbO}_3} = 0.389$ (1) nm; $c_{\text{SrRuO}_3} = 0.4004$ (1) nm, $a_{\text{SrRuO}_3} = 0.392$ (3) nm. Деформация элементарной ячейки для NaNbO₃ составила $\varepsilon_{33} = 0.007$, $\varepsilon_{11} = 0.002$. Диэлектрические и пьезоэлектрические измерения свидетельствуют о том, что пленки находятся в сегнетоэлектрическом состоянии.

Ключевые слова: тонкие пленки, ниобат натрия, диэлектрические характеристики, деформация элементарной ячейки.

DOI: 10.21883/PJTF.2020.02.48945.18046

Антисегнетоэлектрики (АСЭ) со структурой типа перовскита в последние годы привлекают к себе значительное внимание в физическом материаловедении, что связано с перспективами их использования, в частности, в устройствах хранения и накопления энергии [1] или в качестве катализаторов [2]. Одним из ярких представителей данной группы материалов является ниобат натрия — NaNbO₃. Впервые в крупнокристаллическом состоянии он был синтезирован в 1951 г., а в виде тонких пленок, которым посвящена настоящая работа, получен относительно недавно — 10-15 лет назад. Авторами ряда работ показано, что в тонких пленках NaNbO3 могут реализовываться как АСЭ-, так и сегнетоэлектрические (СЭ) состояния с величиной спонтанной поляризации до $50\,\mu\text{C/cm}^2$ [3–5], а в гетероструктуре NaNbO₃/(110)NdGaO₃ по данным диэлектрической спектроскопии имеет место большая анизотропия диэлектрической проницаемости и проявляются свойства СЭ-релаксоров с характерной дисперсией при сегнетопараэлектрическом фазовом переходе [6]. Проведенный нами анализ литературы показал, что эффекты "деформационной инженерии" (изменение свойств материала под воздействием деформационных полей различной природы) в случае ниобата натрия проявляются достаточно ярко, однако полученные различными научными коллективами результаты часто разнятся, что свидетельствует о существенной зависимости его свойств от технологии роста пленок. Особенностью NaNbO3 является наличие у него необычно большого для оксидов семейства перовскита числа структурных фазовых переходов, природа которых, несмотря на имеющийся огромный

экспериментальный материал, полностью не выяснена. Настоящая работа посвящена получению гетероэпитаксиальных тонких пленок NaNbO₃ одностадийным методом RF-катодного распыления и исследованию их структуры, диэлектрических и пьезоэлектрических свойств.

Напыление пленок NaNbO₃ (NNO) и SrRuO₃ (SRO), используемого в качестве нижнего электрода при диэлектрических измерениях, осуществлялось методом высокочастотного распыления на установке "Плазма 50 СЭ" (ЦКП ЮНЦ РАН). В качестве подложки использовался монокристаллический MgO среза (001) толщиной 0.5 mm (производитель — фирма "МТІ Corporation", USA). Структурное совершенство пленок, параметры элементарной ячейки в направлении нормали к плоскости подложки, а также ориентационные соотношения между пленкой и подложкой устанавливались с помощью рентгенографирования на дифрактометре "ДРОН-4-07" методом $\theta/2\theta$ (Си K_{α} -излучение). Измерения вольт-фарадных характеристик C(U) осуществлялись на анализаторе TF Analyzer 2000 (ЦКП НИИ физики ЮФУ). Продольный пьезомодуль d_{33} измерялся квазистатическим методом на частоте 800 Hz с применением методики, подробно описанной в [7]. Смещающее пилообразное напряжение подавалось с использованием генератора сигналов специальной формы АКИП 3408/2.

На рис. 1 представлены результаты рентгенодифракционного анализа двухслойной гетероструктуры NaNbO₃/SrRuO₃/MgO(001), выращенной по технологии прерывистого напыления MgO(001) \rightarrow SrRuO₃(200 nm)/MgO(001) \rightarrow NaNbO₃/SrRuO₃(200 nm)/MgO(001). В исследованной гетероструктуре не обнаружено следов



Рис. 1. $a - \theta - 2\theta$ -рентгенограмма пленки NaNbO₃ (300 nm)/SrRuO₃(200 nm)/MgO. На вставке — кривая качания рефлекса (002) слоя NaNbO₃. $b - \varphi$ -сканирование отражений (113) MgO и (103) слоев NaNbO₃ и SrRuO₃.

примесных фаз. Эпитаксиальный рост каждого слоя был доказан с помощью φ -сканирования отражений (103) слоев NaNbO₃ и SrRuO₃. Сравнение угловых положений рефлексов (103) слоев пленки с рефлексами (113) подложки, а также тот факт, что на θ -2 θ -рентгенограммах присутствовали только отражения типа (00l) для подложки MgO и каждого слоя NaNbO₃ и SrRuO₃, позволяют утверждать, что слои гетероструктуры NaNbO₃/SrRuO₃/MgO получены при полной параллельной ориентации с подложкой. Иначе говоря, кристаллографические оси каждого из слоев

пленки параллельны осям подложки, что соответствует следующим эпитаксиальным соотношениям:

[100]NaNbO₃ || [100]SrRuO₃ || [100]MgO;

[001]NaNbO₃ || [001]SrRuO₃ || [001]MgO.

Поверхность пленки NaNbO₃, анализ которой проводился методами атомно-силовой микроскопии, характеризуется довольно низкой шероховатостью, составляющей величину ~ 8 nm, которая по мере уменьшения толщины пленки снижалась. Вместе с результатами представленного выше рентгенодифракционного анализа это свидетельствует о том, что исследуемые пленки ниобата натрия были выращены, вероятнее всего, по механизму Вольмера-Вебера. При данном механизме роста пленка NaNbO₃ начинает образовываться в виде трехмерных зародышей на поверхности подложки, которые в дальнейшем срастаются в процессе роста.

Анализ полученных данных для обоих слоев гетероструктуры позволяет установить, что параметры элементарной ячейки *a* и *b* примерно равны между собой, а угол между ними равен $\gamma = 90^{\circ}$. В тетрагональном приближении параметры элементарных ячеек для каждого слоя NaNbO₃ и SrRuO₃ отдельно были следующими: $c_{\text{NaNbO_3}} = 0.3940$ (1) nm, $a_{\text{NaNbO_3}} = 0.389$ (1) nm; $c_{\text{SrRuO_3}} = 0.4004$ (1) nm, $a_{\text{SrRuO_3}} = 0.392$ (3) nm. Сравнение полученных параметров элементарной ячейки NaNbO₃ с параметрами для объемного материала (a = c = 0.3914 nm, b = 0.3881 nm) позволяет определить деформации элементарной ячейки $\varepsilon_{33} = (c_{film} - c_{bulk})/c_{bulk} = 0.007$, $\varepsilon_{11} = 0.002$. При толщинах пленки NaNbO₃ от 100 до 300 nm существенных изменений деформации не фиксировалось.

Для проведения диэлектрических и пьезоэлектрических измерений гетероструктуры NaNbO₃/SrRuO₃/MgO на поверхность пленки NaNbO3 через маску с отверстиями диаметром ~ 180-200 µm осаждались электроды АІ с подслоем Сг методом термического испарения в вакууме. В качестве второго электрода выступал SrRuO₃. На рис. 2 представлены зависимости C(U) и tg $\delta(U)$ для гетероструктуры Al/NaNbO₃/SrRuO₃/MgO. Видно, что зависимость C(U) имеет форму "бабочки", свойственную СЭ-структурам, характеризуется наличием гистерезиса и достаточно высокой диэлектрической управляемостью ($\sim 50\%$ при $U = 100 \, \text{kV/cm}$). При этом объекту свойственны низкие величины tg δ , практически не зависящие от U, что свидетельствует, в частности, об отсутствии электропроводности в пленках NaNbO3 в анализируемом диапазоне U. При проведении измерений величины d₃₃ (рис. 3) в отсутствие смещающего электрического поля было установлено, что пленки характеризуются естественной униполярностью с величиной $d_{33} = -8.5 \,\mathrm{pC/N}$, формирующейся в объекте непосредственно на стадии изготовления. При приложении же положительного напряжения на верхний электрод наблюдалось переключение поляризации при $U \sim 20 \, \text{kV/cm}$, и далее величина d_{33} возрастала и достигала насыщения ~ 100 pC/N при значениях



Рис. 2. Зависимости C(U) и tg $\delta(U)$ для гетероструктуры Al/NaNbO₃(300 nm)/SrRuO₃(200 nm)/MgO. Частота измерительного электрического напряжения с амплитудой 40 mV составляла 100 kHz.



Рис. 3. Зависимости $d_{33}(U)$ для гетероструктуры Al/NaNbO₃(300 nm)/SrRuO₃(200 nm)/MgO.

 $U \sim 100 \text{ kV/cm}$. При снижении U до нуля фиксировалось гистерезисное изменение $d_{33}(U)$ до величины $d_{33}(U = 0) = 20 \text{ pC/N}$, которая в течение 30-40 min плавно релаксировала практически к исходному состоянию. При циклическом воздействии внешнего электрического поля треугольной формы с $U = \pm 100 \text{ kV/cm}$ и периодом 50 s фиксировалась свойственная СЭ петля, которая, как и зависимость C(U), имела незначительную асимметрию, связанную, вероятнее всего, с наличием в объекте внутреннего поля. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что полученные нами тонкие пленки ниобата натрия за счет воздействия эпитаксиальной деформации несоответствия из-за разницы в параметрах элементарных ячеек пленки и подложки находятся в сегнетоэлектрической фазе.

С теоретической точки зрения влияние эпитаксиальной деформации несоответствия на структуру и свойства ряда перовскитов, в том числе и ниобата натрия, для случая изотропных двухосных полей напряжения ранее было рассмотрено с использованием метода функционала плотности [8]. Было показано, что в тонких пленках NaNbO₃, на которые не осуществляется какое-либо механическое воздействие, последовательность индуцированных деформационным полем фазовых переходов с увеличивающейся деформацией несоответствия такова: $c \rightarrow r \rightarrow aa$ (misfit strain для c-фазы менее -0.0055, для *г*-фазы от -0.0055 до 0.00413, для *аа*-фазы более 0.00413). Указанные фазы с, г и аа являются сегнетоэлектрическими с симметрией Р4тт, Ст и Атт2 и электрической поляризацией вдоль [001], в плоскости (110) и вдоль [110] соответственно. Экспериментально данная последовательность фазовых превращений была реализована в [9] на базе исследований тонких пленок толщиной 10-15 nm, выращенных на подложках NdGaO₃(110), SrTiO₃(001), DyScO₃(110), TbScO₃(110), GdScO₃(110) и SrLaGaO₄(001) методом MOCVD (metalorganic chemical vapour deposition), однако диэлектрических и пьезоэлектрических исследований авторами не проводилось. Несмотря на серьезные модельные упрощения работы [8], учитывающей только сегнетоэлектрическую неустойчивость в имеющем несколько структурных переходов NaNbO3, в полученных нами пленках NaNbO3, возможно, действительно реализуется *r*-фаза. Однозначно подтвердить это на данном этапе исследований нам пока не удалось, однако, согласно нашим рентгенодифракционным данным, какойлибо мультипликации ячейки, свойственной объемному NaNbO₃, вдоль направления [001] не наблюдается.

Необходимо отметить, что на фазовое состояние тонкопленочных объектов могут существенно влиять как толщина пленки, так и механизм ее роста, что ярко продемонстрировано на примере титаната бариястронция [10]. Это позволяет ожидать, что и в случае пленок NaNbO₃, выращенных на подложках MgO(001), могут быть реализованы различные фазовые состояния, однако экспериментальные исследования в этом направлении в настоящее время носят преимущественно фрагментарный характер. Поскольку тонкие пленки ниобата натрия и других систем на его основе характеризуются очень перспективными с точки зрения практических приложений диэлектрическими и пьезоэлектрическими характеристиками, мы планируем продолжить исследования в этом направлении.

Финансирование работы

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 19-12-00205).

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- Lui Z., Lu T., Ye J., Wang G., Dong X., Withers R., Liu Y. // Adv. Mater. Technol. 2018. V. 3. P. 1800111. DOI: 10.1002/admt.201800111
- [2] Grabowska E. // Appl. Catalys. B. 2016. V. 186. P. 97. DOI: 10.1016/j.apcatb.2015.12.035
- [3] Maeng W.J., Jung I., Son J.Y. // J. Cryst. Growth. 2012. V. 349.
 P. 24–26. DOI: 10.1002/admt.201800111
- [4] Yuzyuk Yu.I., Shakhovoy R.A., Raevskaya S.I., Raevski I.P., El Marssi M., Karkut M.G., Simon P. // Appl. Phys. Lett. 2010.
 V. 96. P. 222904. DOI: 10.1063/1.3437090
- [5] Yamazoe S., Kohori A., Sakurai H., Kitanaka Y., Noguchi Y., Miyayama M., Wada T. // J. Appl. Phys. 2012. V. 112.
 P. 052007. DOI: 10.1063/1.4746079
- [6] Cai B., Schwarzkopf J., Hollmann E., Schmidbauer M., Abdel-Hamed M.O., Wördenweber R. // J. Appl. Phys. 2014.
 V. 115. P. 224103. DOI: 10.1063/1.4882296
- [7] Мухортов В.М., Колесников В.В., Бирюков С.В., Головко Ю.И., Мащенко А.И. // ЖТФ. 2005. Т. 75. В. 8. С. 126– 131.
- [8] Diéguez O., Rabe K.M., Vanderbilt D. // Phys. Rev. B. 2005.
 V. 72. P. 144101. DOI: 10.1103/PhysRevB.72.144101
- [9] Schwarzkopf J., Schmidbauer M., Remmele T., Duk A., Kwasniewski A., Anooz S., Devi A., Fornari R. // J. Appl. Cryst. 2012. V. 45. P. 1015–1023.
 DOI: 10.1107/S0021889812035911
- [10] Мухортов В.М., Юзюк Ю.И. Гетероструктуры на основе наноразмерных сегнетоэлектрических пленок: получение, свойства и применение. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. 224 с.